

角膜障害測定法

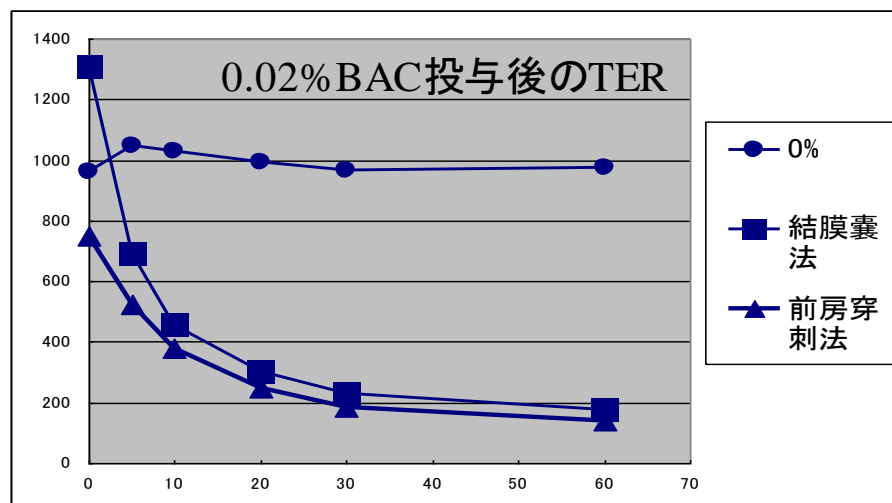
主たる提供特許	出願者	国立大学法人長崎大学、国立大学法人東北大学
	題名	角膜経上皮電気抵抗値の測定方法
	番号	W02009/110470

電気抵抗値による低侵襲で正確な角膜障害測定

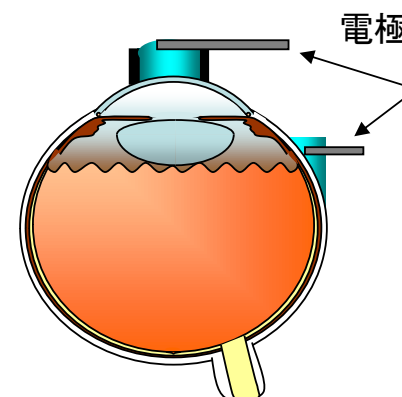
技術概要

発明概要

これまでの電気抵抗値を使った角膜障害の測定は、角膜を切り離したり、眼球内に電極を刺入したりする必要がありましたが、本技術では眼球表面に電極を置くことで侵襲を加えることなく簡単に測定する事が出来ます。



角膜障害の計測例



効果

- ・角膜障害の程度を定量的に評価できます。
- ・短時間の变化も追跡可能です。
- ・少ない侵襲で簡便に測定できます。

応用分野

実用化例

- ・点眼薬による角膜障害の測定装置

企業へのメッセージ

技術移転先企業を探しています。